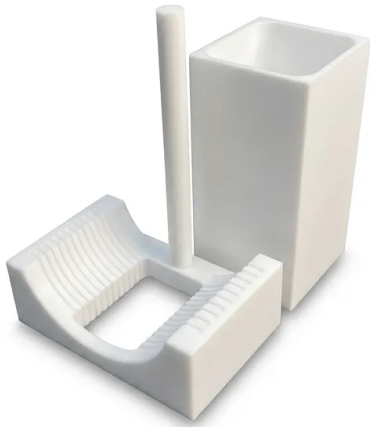


6-Zoll Runder Ptfе-Wafträger Säure- Und Alkalibeständig Reinigungs-Blumenkorb Für Halbleiter Anpassbar

Artikelnummer: PL-CP55



Einführung

Hochreine 6-Zoll PTFE-Wafträger entwickelt für anspruchsvolle Nassprozesse in der Halbleiterfertigung. Diese anpassbaren Blumenkörbe sind auf extreme Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität ausgelegt und gewährleisten eine gleichmäßige Reinigung sowie Substratschutz in aggressiven sauren und alkalischen Tauchumgebungen während der gesamten Produktion.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigung für Halbleiter	Tauchung von Wafern in SC-1- und SC-2-Lösungen zur Entfernung von organischen und ionischen Verunreinigungen.	Vollständige Beständigkeit gegenüber Oxidationsmitteln und hochwarmen Basen.
Nassätzprozesse	Selektives Entfernen von Materialschichten mit Flußsäure (HF) oder Phosphorsäure.	Präzise Substratpositionierung gewährleistet eine gleichmäßige Ätztiefe über den gesamten Wafer.
Photolithographie-Stripping	Entfernung von Photolackschichten mit aggressiven organischen Lösungsmitteln oder Piranha-Lösungen.	Das Material quillt nicht und zersetzt sich nicht bei Einwirkung harter Lösungsmittel.
Texturierung von Solarzellen	Großvolumige Reinigung und Oberflächentexturierung von Siliziumwafern zur Verbesserung des Wirkungsgrads.	Das langlebige Design hält den Belastungen von industriellen Chemiedurchsätzen stand.
Spülung nach CMP	Entfernung von Slurry-Partikeln und Chemikalien nach der chemisch-mechanischen Politur.	Ultra-glatte Oberflächen verhindern das Wiederanhaften von Partikeln und erleichtern das Spülen.
Vorbereitung für Spurenanalyse	Reinigung von hochreinen Laborbauteilen in konzentrierter Salpeter- oder Salzsäure.	Eliminiert Kreuzkontaminationsrisiken für die Elementaranalyse im Ultra-Spurenbereich.
MEMS-Fertigung	Spezielle Substrathandhabung für die Produktion von mikroelektromechanischen Systemen.	Anpassbare Schlitzabmessungen nehmen nicht standardmäßige Substratdicken auf.

Parameter	Spezifikation für PL-CP55
Produktbezeichnung	PL-CP55 Runder Wafträger (Blumenkorb)
Materialzusammensetzung	Hochreines jungfräuliches Polytetrafluorethylen (PTFE)
Kompatibilität Wafergröße	Standard 6-Zoll (150 mm) (kundenspezifische Größen verfügbar)
Konfiguration	Runder geschlitzter Korb / gelochtes Blumendesign
Schlitzanzahl / Kapazität	Anpassbar (Standardoptionen: 10, 25 oder 50 Schlitze)
Betriebstemperatur	-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
Chemikalienbeständigkeit	pH 0-14 (allgemeine Säure-/Alkali-/Lösungsmittelbeständigkeit)
Schlitzbreite / Abstand	Vollständig anpassbar nach Kundenspezifikation

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikation für PL-CP55	
Griffart	Integrierter fester Griff oder abnehmbarer schwenkbarer PTFE-Griff (anpassbar)	
Oberflächenbeschaffenheit	CNC-gefräst glatt (typischerweise Ra ≤ 0,8 µm)	
Fertigungsverfahren	100 % präzise CNC-gefräst (kundenspezifisches Produkt)	
Abmessungen	Kundenspezifisch ausgelegt für passende Nassbank- oder Tankabmessungen	